

Реєстраційна картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0117U004875

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-03-2017

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки ()

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

У тому числі по роках:	
2017	800 тис. грн.
2018	800 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування: 1600 тис. грн.	

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 38621185

Місцезнаходження: просп. Перемоги, 10, м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 3804444813221, 3804444814763

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Науковий фізико-технологічний центр Міністерства освіти і науки та НАН України

Код за ЄДРПОУ: 14096245

Місцезнаходження: , м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (0572) 321031

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Технологія вакуумно-плазмового формування конструкційних елементів для нанoeлектроніки

Назва роботи англійською:

The technology of forming the vacuum-plasma structural components for nanoelectronics

Мета роботи українською:

Технологія формування вакуумно-плазмовими методами конструкційних елементів для нанoeлектроніки на основі кластерної вакуумно-плазмової установки. Визначення фізико-технічних характеристик експериментально отриманих наноструктурованих елементів. Адаптація технології до промислових умов функціонування.

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Інше

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Технології

Галузь застосування: Машинобудування

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Бажин Анатолій Іванович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розрахунки та математичне моделювання параметрів плазми і потоків заряджених частинок у реактивній камері модуля. Розробка та створення реактивного модуля плазмохімічного та іонно-плазмового травління. Запуск і випробування модуля.

Початок етапу: 01.2017

Закінчення етапу: 12.2017

Вид звітнього документа: Проміжний звіт

Номер етапу: 2

Назва етапу: Технологія формування наноструктурованих елементів для електроніки. Відпрацювання технологічних режимів формування нанорозмірних елементів для електроніки.

Початок етапу: 01.2018

Закінчення етапу: 12.2018

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 539.12.04, 621.384.653.539.12.04

Коди тематичних рубрик: 29.15.35

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Фаренік Володимир Іванович

к. ф.-м. н.

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Турбін П.В.

Телефон

+38 (093) 529-14-28

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.